

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第1部門第2区分
【発行日】令和2年7月27日(2020.7.27)

【公表番号】特表2019-517884(P2019-517884A)
【公表日】令和1年6月27日(2019.6.27)
【年通号数】公開・登録公報2019-025
【出願番号】特願2018-565328(P2018-565328)
【国際特許分類】

A 6 1 M 16/06 (2006.01)

【F I】

A 6 1 M 16/06 A

【手続補正書】

【提出日】令和2年6月12日(2020.6.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0073

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0073】

ある実施形態において、導管フレームはシールハウジングの吸気開口に解放可能に受け入れられかつ保持され、導管フレームは気体供給導管の端部に接続されるかまたは接続可能である。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0093

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0093】

別の態様において、本発明は、広義には、鼻マスクインターフェイス組立体であって、シールハウジングと、マスク空洞を画定するためにシールハウジングに接続されるかまたは接続可能な可撓性鼻シールであって、顔に接触する側と外側との間に延在し、かつマスク空洞内への鼻受入開口を画定するエッジを含み、かつユーザの鼻の周りを密封するように構成される接触面を含む可撓性鼻シールと、シールハウジングにおける偏流通気穴の配置構成であって、シールハウジングの上部領域にわたって側方に延在する偏流通気穴の少なくとも1つの上配列と、シールハウジングの側部の下方部分に延在する偏流通気穴の少なくとも1つの側方配列とを含む偏流通気穴の配置構成とを含むシールハウジングを含む鼻マスクインターフェイス組立体に関する。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0108

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0108】

【図1】例えば持続気道陽圧(CPAP)システムで加熱および加湿された気体流をユーザに提供するためのシステムの概略図である。

【図2A】耳上ヘッドギア構成でユーザの頭部に固定された鼻マスクインターフェイスの概略図である。

【図2B】使用中に鼻マスクインターフェイスが受ける力に関する力ダイアグラムを示す

。

- 【図3】ユーザの鼻の鼻下面の鼻の生体構造の概略図である。
- 【図4】第1実施形態の第1形態による、鼻マスクインターフェイスまたは組立体の前または顔に接触する側（または着用者側）の図であり、鼻下支持構成を備えた鼻シールを組立体の中央延長部、シールハウジング、およびヘッドギアフレームとともに示す。
- 【図5】第1実施形態の鼻マスクインターフェイスの背面または外側図である。
- 【図6】第1実施形態の鼻マスクインターフェイスの上方前側斜視図である。
- 【図7】第1実施形態の鼻マスクインターフェイスの下方前側斜視図である。
- 【図8】第1実施形態の鼻マスクインターフェイスの下面図である。
- 【図9】第1実施形態の鼻マスクインターフェイスの上面図である。
- 【図10】第1実施形態の鼻マスクインターフェイスの側面図である。
- 【図11】第1実施形態の鼻マスクインターフェイスのシールハウジングおよびヘッドギアフレームの外側底部斜視図である。
- 【図12】第1実施形態の鼻マスクインターフェイスのシールハウジングおよびヘッドギアフレームの着用者側上方斜視図である。
- 【図13】第1実施形態の鼻マスクインターフェイスの鼻シールの顔に接触する側（または着用者側）からの正面図である。
- 【図14】第1実施形態の鼻シールの外側からの背面図である。
- 【図15】第1実施形態の鼻シールの上面図である。
- 【図16】第1実施形態の鼻シールの下面図である。
- 【図17】第1実施形態の鼻シールの外側からの第1背面下側斜視図である。
- 【図18】第1実施形態の鼻シールの外側からの第2背面上方斜視図である。
- 【図19】第1実施形態の鼻シールの顔に接触する側からの第1上方斜視図である。
- 【図20】第1実施形態の鼻シールの顔に接触する側からの第2下側斜視図である。
- 【図21】第1実施形態の鼻シールの側面図である。
- 【図22】図13の中央線A-Aを通る第1実施形態の鼻シールの断面図である。
- 【図23】第1実施形態の鼻シールの第2形態の顔に接触する側からの正面斜視図であり、鼻下支持構成は、鼻シールの顔に接触する面のエッジから完全に分離されているかまたは離されている。
- 【図24】左および右側延長部分を備えた鼻下支持構成を有する第2実施形態の鼻シールの第1形態の、顔に接触する側からの正面図である。
- 【図25】第2実施形態の鼻シールの外側からの背面図である。
- 【図26】第2実施形態の鼻シールの側面図である。
- 【図27】第2実施形態の鼻シールの外側からの斜視図である。
- 【図28】第2実施形態の鼻シールの外側からの背面斜視図である。
- 【図29】鼻下支持構成が鼻シールの顔に接触する面のエッジから完全に分離されているかまたは離されている、第2実施形態の鼻シールの第2形態の正面斜視図である。
- 【図30】「浮揚性」鼻下支持構成を有する第3実施形態の鼻シールの正面図である。
- 【図31】第3実施形態の鼻シールの外側からの背面図である。
- 【図32】第3実施形態の鼻シールの側面図である。
- 【図33】第3実施形態の鼻シールの顔に接触する側からの正面斜視図である。
- 【図34】第3実施形態の鼻シールの外側からの背面斜視図である。
- 【図35】第4実施形態による鼻マスク組立体の側面図であり、着用者での使用において示されている。
- 【図36】第4実施形態の鼻マスク組立体の斜視図であり、特に鼻シール、シールハウジング、ヨーク、および導管フレームを含む鼻マスクインターフェイスを示し、鼻マスクインターフェイスは、ヘッドギアおよび可撓性気体供給導管に接続されている。
- 【図37】鼻シール、シールハウジング、ヨーク、および導管フレームを示す、第4実施形態の鼻マスクインターフェイスの外側からの上方斜視図である。
- 【図38】第4実施形態の鼻マスクインターフェイスの正面または顔に接触する側からの

上方斜視図である。

- 【図 39】第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの上斜視分解図を示す。
- 【図 40】第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの下斜視分解図を示す。
- 【図 41】第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの背面または外側図を示す。
- 【図 42】第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの側面図である。
- 【図 43】第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの正面または顔に接触する側の図である。
- 【図 44】第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの上面図である。
- 【図 45】第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの下面図である。
- 【図 46】図 41 に示された中央線 A A を通る第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの断面図である。
- 【図 47】第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの鼻シールの正面または顔に接触する側の図である。
- 【図 48】第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの鼻シールの背面図である。
- 【図 49】鼻シールの第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの外側からの下側斜視図である。
- 【図 50】鼻シールの第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの外側からの上方斜視図である。
- 【図 51】第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの鼻シールの側面図である。
- 【図 52】第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの鼻シールの上面図である。
- 【図 53】第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの鼻シールの下面図である。
- 【図 54】図 52 の線 A B を通る第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの鼻シールの断面図である。
- 【図 55】図 47 の線 A C を通る第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの鼻シールの斜視断面図である。
- 【図 56】図 47 の線 A C を通る第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの鼻シールの断面図である。
- 【図 57】図 47 の線 A G を通る第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの鼻シールの断面図である。
- 【図 58】図 56 の領域 A D の詳細図であり、特に第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの鼻シールの鼻下支持体の一部の角度寸法プロファイルを示す。
- 【図 59】小～中サイズの密封構成のために構成される第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの鼻下支持体の背面詳細図であり、特に鼻下支持体の中央部分の曲率半径を示す。
- 【図 60】中～大サイズの密封構成のために構成される第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの鼻下支持体の背面詳細図であり、特に鼻下支持体の中央部分の曲率半径を示す。
- 【図 61】第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの鼻下支持体の別の形態の背面詳細図を示し、鼻下支持体は、修正された代替的な略四角の形状を有する。
- 【図 62】第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの鼻シールの鼻下支持体の中央領域の詳細上方斜視図を示し、特に小～中サイズの密封構成のための鼻下支持体の一部の幅寸法を識別する。
- 【図 63】第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの鼻シールの鼻下支持体の中央領域の詳細上方斜視図を示し、特に中～大サイズの密封構成のための鼻下支持体の一部の幅寸法を識別する。
- 【図 64】第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの鼻シールの鼻下支持体の中央接続部分の一部の詳細断面図、特に小～中サイズの密封構成のための中央接続部分の角度寸法を示す。
- 【図 65】第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスの鼻シールの鼻下支持体の中央接続部分の一部の詳細断面図、特に中～大サイズの密封構成のための中央接続部分の角度寸法

を示す。

【図66】第4実施形態の鼻マスクインターフェイスの鼻シールの鼻梁領域の詳細上側図、特に小～中サイズの密封構成のための接触面の谷部領域を示す。

【図67】第4実施形態の鼻マスクインターフェイスの鼻シールの鼻梁領域の詳細上側図、特に中～大サイズの密封構成のための接触面の谷部領域を示す。

【図68】第4実施形態の鼻マスクインターフェイスのシールハウジングの外側からの上方斜視図である。

【図69】第4実施形態の鼻マスクインターフェイスのシールハウジングの着用者側からの下側斜視図である。

【図70】第4実施形態の鼻マスクインターフェイスのシールハウジングの外側の背面図である。

【図71】第4実施形態の鼻マスクインターフェイスのシールハウジングの着用者側の正面図である。

【図72】第4実施形態の鼻マスクインターフェイスのシールハウジングの側面図である。

【図73】第4実施形態の鼻マスクインターフェイスのシールハウジングの上面図である。

【図74】第4実施形態の鼻マスクインターフェイスのシールハウジング底部または下面図である。

【図75】第4実施形態の鼻マスクインターフェイスの導管フレームの導管接続端部からの上方斜視図である。

【図76】第4実施形態の鼻マスクインターフェイスの導管フレームのシールハウジング接続端部からの上方斜視図である。

【図77】第4実施形態の鼻マスクインターフェイスの導管フレームの上面図である。

【図78】第4実施形態の鼻マスクインターフェイスの導管フレームの側面図である。

【図79】図77の線A-Lを通る第4実施形態の鼻マスクインターフェイスの導管フレームの断面図である。

【図80】導管フレームの導管接続端部からの第4実施形態の鼻マスクインターフェイスの導管フレームの端面図である。

【図81】導管フレームのシールハウジング接続端部からの第4実施形態の鼻マスクインターフェイスの導管フレームの端面図である。

【図82】外側からの第4実施形態の鼻マスクインターフェイスのヨークの上方斜視図である。

【図83】第4実施形態の鼻マスクインターフェイスのヨークの頂部分解図である。

【図84】第4実施形態の鼻マスクインターフェイスのヨークの上面図である。

【図85】第4実施形態の鼻マスクインターフェイスのヨークの下面図である。

【図86】外側からの第4実施形態の鼻マスクインターフェイスのヨークの正面図である。

【図87】第4実施形態の鼻マスクインターフェイスのヨークの側面図である。

【図88】第4実施形態の鼻マスクインターフェイスのヨークの部分分解正面図であり、特に分離されたヨークの端部キャップを示す。

【図89】第4実施形態の鼻マスクインターフェイスのヨークの別の部分分解正面図であり、特にヨークバックに接続されたヨークの端部キャップを示す。

【図90】第4実施形態の鼻マスクインターフェイスのヨーク組立体のヨークフロントの背面または内面側面図である。

【図91】第4実施形態の鼻マスクインターフェイスのヨーク組立体のヨークフロントの背面または内面側面図であり、自動的に調整可能なヘッドギア組立体の方向性ロックおよびフィラメントを示す。

【図92】第4実施形態の鼻マスクインターフェイスによるヘッドギア調整機構のコンポーネントを示すヨーク組立体の代替的構成の部分断面図である。

【図 9 3】端部キャップを第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスのヨークの端部に結合する方法を示す。

【図 9 4】組み立てられた図 9 3 の端部キャップおよびヨークの部分背面斜視図である。

【図 9 5】第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスのヨークのヨーク端部の端面図である。

【図 9 6】図 9 5 のヨーク端部の上面図である。

【図 9 7】図 9 5 における線 A K に沿った、ヨーク端部に結合された端部キャップの断面図である。

【図 9 8】図 9 7 の端部キャップの断面図である。

【図 9 9】第 4 実施形態の鼻マスクインターフェイスのヨークの方向性ロックの断面図であり、ロックは、ロックされた位置において示されている。

【図 1 0 0】ロックされた位置にある図 9 9 の方向性ロックの斜視断面図である。

【図 1 0 1】ロック解除された位置にある図 9 9 の方向性ロックの断面図である。

【図 1 0 2】ロック解除された位置にある図 9 9 の方向性ロックの斜視断面図である。

【図 1 0 3】鼻シールと、一体化導管コネクタを備えた鼻シールハウジングと、ヨークとを含む、第 5 実施形態の鼻マスクインターフェイスの第 1 形態の外側の斜視図である。

【図 1 0 4】正面または顔に接触する側からの、図 1 0 3 の第 1 形態の鼻マスクインターフェイスの上方斜視図である。

【図 1 0 5】図 1 0 3 の第 1 形態の鼻マスクインターフェイスの外側図である。

【図 1 0 6】図 1 0 3 の第 1 形態の鼻マスクインターフェイスの側面図である。

【図 1 0 7】ヨークなしの、図 1 0 6 の第 1 形態の鼻マスクインターフェイスの側面図である。

【図 1 0 8】図 1 0 7 に示された第 1 形態の鼻マスクインターフェイスの外側斜視図である。

【図 1 0 9】図 1 0 3 の第 1 形態の鼻マスクインターフェイスのシールハウジングの外側図である。

【図 1 1 0】図 1 0 9 のシールハウジングの着用者側の図である。

【図 1 1 1】図 1 0 3 の第 1 形態の鼻マスクインターフェイスの鼻シールの正面または顔に接触する側の図である。

【図 1 1 2】図 1 1 1 の鼻シールの背面または外側図である。

【図 1 1 3】図 1 1 1 の鼻シールの側面図である。

【図 1 1 4】図 1 0 5 の線 B B を通る、図 1 0 3 の第 1 形態の鼻マスクインターフェイスの断面図である。

【図 1 1 5】図 1 0 3 の第 1 形態の鼻マスクインターフェイスのヨークの、着用者側斜視図を示す。

【図 1 1 6】図 1 0 3 の第 1 形態の鼻マスクインターフェイスのヨークの、正面外側図を示す。

【図 1 1 7】図 1 0 3 の第 1 形態の鼻マスクインターフェイスのヨークの、上面図を示す。

【図 1 1 8】第 5 実施形態の鼻マスクインターフェイスの第 2 形態の外側の斜視図である。

【図 1 1 9】図 1 1 8 の第 2 形態の鼻マスクインターフェイスの側面図である。

【図 1 2 0】図 1 1 8 の第 2 形態の鼻マスクインターフェイスの外側図である。

【図 1 2 1】図 1 1 8 の第 2 形態の鼻マスクインターフェイスの正面または顔に接触する側の図である。

【図 1 2 2】図 1 1 8 の第 2 形態の鼻マスクインターフェイスのシールハウジングの外側図である。

【図 1 2 3】図 1 1 8 の第 2 形態の鼻マスクインターフェイスのシールハウジングの側面図である。

【図 1 2 4】図 1 1 8 の第 2 形態の鼻マスクインターフェイスのヨークの正面斜視図を示す。

す。

【図125】図118の第2形態の鼻マスクインターフェイスのヨークの外面図を示す。

【図126】図118の第2形態の鼻マスクインターフェイスのヨークの上面図を示す。

【図127】図120の線BCを通る、図118の第2形態の鼻マスクインターフェイスの断面図である。

【図128】図127の領域BDの詳細断面図である。

【図129】第5実施形態の鼻マスクインターフェイスの第3形態の外面斜視図である。

【図130】図129の第3形態の鼻マスクインターフェイスの側面図である。

【図131】図129の第3形態の鼻マスクインターフェイスの外面図である。

【図132】図129の第3形態の鼻マスクインターフェイスの正面または顔に接触する側の図である。

【図133】図129の第3形態の鼻マスクインターフェイスのシールハウジングの外面図である。

【図134】図133のシールハウジングの側面図である。

【図135】図129の第3形態の鼻マスクインターフェイスの鼻シールの顔に接触する側の図である。

【図136】図135の鼻シールの外面図である。

【図137】図135の鼻シールの顔に接触する側の斜視図である。

【図138】図135の鼻シールの側面図である。

【図139】図135の線BEを通じた鼻シールの断面図である。

【図140】第5実施形態の鼻マスクインターフェイスの第4形態の外面斜視図である。

【図141】図140の第4形態の鼻マスクインターフェイスの側面図である。

【図142】図140の第4形態の鼻マスクインターフェイスの外面図である。

【図143】図140の第4形態の鼻マスクインターフェイスの顔に接触する側の図である。

【図144】図140の第4形態の鼻マスクインターフェイスのシールハウジングの外面図である。

【図145】図144のシールハウジングの側面図である。

【図146】図140の第4形態の鼻マスクインターフェイスの鼻シールの顔に接触する側からの斜視図である。

【図147】図146の鼻シールの側面図である。

【図148】図146に示された中央線BFを通じた図146の鼻シールの断面図である。

【図149】図142の線BGを通じた第4形態の鼻マスクインターフェイスの断面図であり、形状および寸法についての比較のために、図135の第3形態の鼻マスクインターフェイスの鼻シールの上張りを含む。

【図150】鼻マスクインターフェイスの第6実施形態の正面または顔に接触する側の図であり、特にシールハウジングの導管フレームまたは吸気孔の下に位置するヨークを示す。

【図151】第6実施形態の鼻マスクインターフェイスの外面図である。

【図152】第6実施形態の鼻マスクインターフェイスの側面図である。

【図153】第6実施形態の鼻マスクインターフェイスのシールハウジングおよびヨークの外面図である。

【図154】鼻マスクインターフェイスのシールハウジングおよびヨークの顔に接触する側の図である。

【図155】鼻マスクインターフェイスの第7実施形態の第1形態の鼻シールの顔に接触する側の図であり、鼻シールは、鼻シールの側部から延在する翼状部分を含む。

【図156】図155の第1形態の鼻シールの外面図である。

【図157】図155の第1形態の鼻シールの側面図である。

【図158】実施形態の鼻マスクインターフェイスの第2形態の鼻シールの外面斜視図で

あり、特に鼻シールの側部から延在する（第1形態に比べて）より長い翼状部分を示す。

【図159】図158の第2形態の鼻シールの顔に接触する側の図である。

【図160】図158の第2形態の鼻シールの外面図である。

【図161】図158の第2形態の鼻シールの上面図である。

【図162】ユーザにより着用されている第2形態の鼻シールを含む第7実施形態の鼻マスクインターフェイスの斜視図である。

【図163】鼻マスクインターフェイスの第8実施形態の第1形態の側面図であり、インターフェイスは鼻シールまたはシールハウジングから延在する前額支持体を含む。

【図164】図163の鼻マスクインターフェイスの第1形態を着用するユーザの斜視図である。

【図165】第8実施形態の鼻マスクインターフェイスの第2形態の顔に接触する側の図であり、鼻シールは鼻梁支持突出部を含む

【図166】図165の第2形態の鼻シールの外面図を示す。

【図167】図165の第2形態の鼻シールの側面図を示す。

【図168】図166の線E-Eを通る、図165の第2形態の鼻シールの断面図を示す。

【図169】図165の第2形態の鼻シールを着用しているユーザの斜視図である。

【図170】図169の第2形態の鼻シールを着用しているユーザの側面図であり、鼻梁支持突出部とユーザの鼻梁との間の間隙を示す。

【図171】第9実施形態の鼻マスクインターフェイスの第1形態の鼻シールの外面図であり、鼻シールは、鼻マスク内に追加的な支持体リップを含む。

【図172】図171の第1形態の鼻シールの顔に接触する側の図である。

【図173】図171の線F-Fを通る、第1形態の鼻シールの断面図である。

【図174】鼻シールの図173の断面図の斜視図である。

【図175】第9実施形態の鼻マスクインターフェイスの第2形態の鼻シールの顔に接触する側の図である。

【図176】図175の第2形態の鼻マスクの外面図である。

【図177】図175の第2形態の鼻シールの側面図である。

【図178】図175の線F-Gを通る、第2形態の鼻シールの断面図である。

【図179】図175の第2形態の鼻シールを着用するユーザの斜視図である。

【図180】図179の第2形態の鼻シールを着用するユーザの側面断面図である。

【図181】形状および寸法の比較を示すために、互いに重ねられた図171および175の第1形態および第2形態の鼻シールの断面図である。

【図182】形状および寸法の比較のために互いに重ねられた図171および175の第1および第2形態の鼻シールの顔に接触する側の図である。

【図183】第9実施形態の鼻マスクインターフェイスの第3形態の鼻シールの外面斜視図である。

【図184】図183の第3形態の鼻シールの外面図である。

【図185】図183の第3形態の鼻シールの顔に接触する側の図である。

【図186】第10実施形態の鼻マスクインターフェイスのシールハウジングおよび導管フレーム組立体の第1形態の外面斜視図である。

【図187】図186の第1形態のシールハウジングおよび導管フレーム組立体の分解図である。

【図188】図186の第1形態の組立体の導管フレームの側面図である。

【図189】図186の第1形態の組立体の導管フレームの上面図である。

【図190】第10実施形態の鼻マスクインターフェイスの第2形態のシールハウジングおよび導管フレーム組立体の外面斜視図である。

【図191】図190の第2形態の組立体の分解図である。

【図192】図190の第2形態の組立体の導管フレームの側面図である。

【図193】図190の第2形態の組立体の導管フレームの上面図である。

【図194】第10実施形態の鼻マスクインターフェイスの第3形態のシールハウジング

および導管フレーム組立体の外面斜視図である。

【図195】図194の第3形態の組立体の分解斜視図である。

【図196】図194の第3形態の組立体の導管フレームの側面図である。

【図197】図194の第3形態の組立体の導管フレームの上面図である。

【図198】第10実施形態の鼻マスクインターフェイスの第4形態のシールハウジングおよび導管フレーム組立体の外面斜視図である。

【図199】図198の第4形態の組立体の分解斜視図である。

【図200】図198の第4形態の組立体の導管フレームの側面図である。

【図201】図198の第4形態の組立体の導管フレームの上面図である。

【図202】第10実施形態の第5形態の鼻マスクインターフェイスのシールハウジングおよび導管フレーム組立体の外面斜視図である。

【図203】図202の第5形態の組立体の分解斜視図である。

【図204】図202の第5形態の組立体の導管フレームの側面図である。

【図205】図202の第5形態の組立体の導管フレームの上面図である。

【図206】第11実施形態による鼻下支持構成を備えたフルフェイスシールの正面図である。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0110

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0110】

加湿室14は、空気流を加湿するために加湿器17の加熱器プレート16と接触している熱伝導性ベースを有する。加湿された空気をユーザインターフェイス11に運ぶために、導管12が加湿室14の排気口13に接続されている。加湿器17は、コントローラ18、例えば、限定するものではないが、例えば関連するメモリに格納されたコンピュータソフトウェア命令を実行するマイクロプロセッサを用いるコントローラを含む。コントローラ18は、ユーザ入力インターフェイス19、例えばダイヤルまたはタッチスクリーンを含む複数のソースから入力命令を受信し、これは、ユーザUに供給された加湿された空気の湿気、温度、または他の特徴の所定の値の設定を可能にする。コントローラ18は、1つまたは複数の他のソース、例えばコントローラ18と連通するためにコネクタ22を通じて接続された温度および/もしくは流速センサ20および21、ならびに/または加熱器プレート温度センサ23などから入力を受信することもできる。ユーザ設定の湿気または温度値に応じて、コントローラ18は、加湿室14に含まれる水を好適に加熱するために、いつおよび/またはどのレベルで加熱器プレート16が通電されるべきかを決定する。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0111

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0111】

室における水の容積が加熱されると、水蒸気が水の表面より上の室の容積を充填し始める。水蒸気は、吸気口26を通じて加湿室14に入る、ブロワ27などの供給装置25から提供された空気流とともに加湿室の排気口13を通過して出る。ブロワ27は、変速ファンであり得、または可変圧力調整器を含み得る。ブロワ27は、吸気口28を通じて空気を引き込む。ブロワは、例えば、コントローラ29またはコントローラ18により制御され得る。コントローラは、任意の好適な基準に従ってブロワ速度、調節された圧力などを制御し得る。例えば、コントローラは、コントローラ18からの入力、ならびにユーザインターフェイス30（例えば、ダイヤル）で設定され得る圧力および/またはファン速度

のユーザ設定値（例えば、予め設定された値）に応じることができる。

【手続補正 6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0118

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0118】

図 2 A および 2 B を参照すると、耳上片側ストラップヘッドギア構成 5 2 が、T 部片フレームに固定されたヘッドギアと比べて快適さの観点で好ましいが、使用時、マスクが陽圧で気体をユーザの鼻に送達しているフロー治療中に力 F が鼻マスクインターフェイスに作用するとき、鼻マスクがユーザの顔の上にずり上がるか、スライドするか、またはスリップする傾向があり、これは、ユーザの鼻の周りのシーリングの堅牢性に影響を及ぼし得、かつ漏出または漏出経路を生じ得ることが発見された。鼻シールのずり上がりは、ユーザの心をかき乱し不快であり得る。鼻マスクインターフェイスは、各側部ストラップからのユーザの鼻と耳上との間の側部ストラップの一般的な方向に沿ってベクトル A により表された実質的に斜めの力と、対抗する実質的に水平な噴出力 B であって、使用時、際陽圧気体のフローが着用者に送達されるときに鼻インターフェイスをユーザの鼻および顔から離れるように実質的に水平に押しやる噴出力 B とを受けることが発見された。ベクトル R により表された実質的に垂直な合力において鼻マスクインターフェイスに作用するヘッドギア力 A および噴出力 B の合力 R である。

【手続補正 7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0139

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0139】

図 2 1 および 2 2 を参照すると、鼻シール 1 0 2 は、顔に接触する面部分 1 2 0 と、側壁部分 1 2 6 であって、シールの周辺部の周りで接触面 1 2 0 から後方に延在し、かつシールハウジング 1 0 4 の開口 1 4 0 に結合するかまたは接続可能なシールの外部または外側で、全体として 1 2 7 で示される接続エッジで終端する側壁部分 1 2 6 とにより実質的に画定される。上述のとおり、この実施形態において、鼻シール 1 0 2 は、シールハウジングに解放可能に接続可能であり、側壁 1 2 6 の終端エッジは、周辺チャンネル 1 2 8 であって、シールハウジング 1 0 4 の開口 1 4 0 に提供された優遇周辺リッジまたは延長部と係合するように構成される周辺チャンネル 1 2 8 を含む。先に検討されたとおり、代替的实施形態において、可撓性鼻シール 1 0 2 は、例えば、オーバーモールド、溶接または他の接続方法を介してシールハウジング 1 0 4 に永続的または半永続的に接続または結合され得る。さらなる代替的实施形態において、インターフェイスは、鼻シールの外部または外側で接続エッジ 1 2 7 に対応するように成形された半剛性または剛性クリップコンポーネントを備えて提供され得る。そのような実施形態において、シールの接続エッジ 1 2 7 は、シールの外側に剛性エッジまたは部分を提供するように剛性クリップコンポーネントにオーバーモールドされ得るか、または他の方法で永続的に接続され得る。剛性クリップコンポーネントは、相補的ベースまたはハウジングコンポーネントと係合するかまたはそうでなければ接続し、それにより鼻シールをベースまたはハウジングに結合するように構成され得る。

【手続補正 8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0145

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0145】

この実施形態において、鼻下支持体 1 2 4 は、中央延長部分 1 3 2 であって、主側方部分 1 2 9 から中央に延在し、かつ上唇領域 1 2 1 における接触面 1 2 0 の開口エッジ 1 2 2 へまたは上唇領域 1 2 1 における接触面 1 2 0 の開口エッジ 1 2 2 で結合または接続される中央延長部分 1 3 2 をさらに含む。代替的实施形態において、図 2 3 を参照して後に説明されるとおり、中央延長部分 1 3 2 は、代替的に、シールの開口エッジ 1 2 2 より下の接触面 1 2 0 の上唇領域 1 2 1 の下部に接続され得、または代替的に例えば接触面 1 2 0 の後方にある鼻シールの側壁 1 2 6 の下部に接続されるなど、接触面 1 2 0 から少なくとも部分的にまたは全体として変位されたかまたは離されている位置で接続され得る。

【手続補正 9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 5 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 5 1】

代替的第 2 形態 - 鼻シールの開口エッジから完全に分離されているかまたは離されている中央延長部分

図 2 3 を参照すると、第 1 実施形態の鼻シール 1 0 2 A の代替的形態が示されている。鼻シール 1 0 2 A は、鼻シールの顔に接触する面 1 2 0 のエッジから完全に分離されているかまたは離されている異なる鼻下支持構成 1 2 4 A を有することを除き、第 1 実施形態の鼻シール 1 0 2 と同様である。同様の符号は、同様のコンポーネントを表す。代替的鼻下支持構成 1 2 4 A は、主側方部分 1 2 9 と中央延長部分 1 3 2 A とを含む。鼻シール 1 0 2 との違いは、中央延長部分 1 3 2 A が接触面 1 2 0 のエッジ 1 2 2 に結合または接続せず、むしろ上唇領域における接触面の下部に、または代替的に接触面 1 2 0 の一部、例えば鼻シールの下部側壁 1 2 6 の一部でないシールの下部領域の一部に結合または接続される点である。この構成において、鼻下支持体 1 2 4 A は、接触面 1 2 0 のエッジ 1 2 2 から完全に分離され、いくつかの構成では、主側方部分 1 2 9 および中央延長部分 1 3 2 A が、ユーザの顔に係合する接触面 1 2 0 から変位されたかまたはそれに隣接する位置で鼻シールのそれぞれの側壁部分に接続するように、接触面 1 2 0 から全て完全に分離されている。鼻シール 1 0 2 A の代替的実施形態は、他の点では機能および構成で鼻シール 1 0 2 と同様であり、第 1 実施形態の鼻シール 1 0 2 と同様に、鼻シールインターフェイス組立体を形成するためにシールハウジング 1 0 4 に結合され得る。

【手続補正 10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 5 8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 5 8】

この構成において、鼻下支持体 1 2 4 D は、より少ない接触面領域を有し、したがってユーザの鼻の鼻下表面のより少ない部分と接触する。特に、中央または側部延長部分のいずれもないと、浮揚性鼻下支持構成 1 2 4 D が接触する鼻下表面は、より少なくなる傾向がある。浮揚性鼻下支持体は、ユーザの鼻のサイズに依存して、鼻の先端でまたは鼻の先端に向かって隣接する翼状リム 8 0 の柱および一部に係合または接触する傾向がある。より大きい鼻を有する人のために、鼻下支持体は、鼻下表面の中間領域においてまたは鼻のベースで鼻下表面にさらに向かって接触し得る。

【手続補正 11】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 8 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 8 9】

図 5 5 を参照すると、この実施形態において、凹状領域またはゾーン 2 4 3 は、リブ 2 4 1 の前部分 2 4 2 a と、鼻下支持体 2 2 4 の主側方部分 2 2 9 に接続する後部部分 2 4 2 b との間に提供または形成される。この凹状領域 2 4 3 は、各リブ 2 4 1 における座屈ゾーンまたは軸 2 4 2 を作り出す。この実施形態において、座屈軸 2 4 2 は、厚さ領域移行境界 2 3 5 と凹状領域 2 4 3 の頂部との間で延在する。

【手続補正 1 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 9 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 9 9】

図 5 6 を参照すると、鼻シールが弛緩状態にあるとき（例えば、使用されていないとき）、中央密封軸 A G が接触面 2 2 0 の中央領域の最外上および下接点間で接線方向に延在するとして定義される。図 5 6 に示されるとおり、中央領域における鼻下支持体の接触面の少なくとも一部は、軸 A H により示されるように、鼻下支持体の接触面が密封軸 A G と平行でなく整列もしていないように、密封軸 A G に対して 2 3 9 で定義または示される角度で延在する。この実施形態において、鼻下支持体 2 2 4 の中央領域における接触面は、およそ 40° ~ およそ 80°、より好ましくはおよそ 45° ~ およそ 75°、なおより好ましくはおよそ 50° ~ およそ 70°、なおより好ましくはおよそ 55° ~ およそ 65° の範囲で密封軸 A G からオフセットされたある角度で方向付けられている。図示のとおり、中央接続部分 2 3 2 の少なくとも一部も、対応するかまたは整列された角度オフセットを有する。

【手続補正 1 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 2 2 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 2 2 9】

図 7 9 を参照すると、導管フレーム 2 1 1 の、2 8 9 A で示された第 1 領域は、突出または延在してシールハウジング 2 0 4 の優遇吸気孔 2 6 5 内へ係合する接続部分 2 8 5 を識別する。第 2 端 2 8 3 B に向かう 2 8 9 B で示された導管フレームの第 2 の残りの部分は、シールハウジングから延在または突出する。導管フレーム 2 1 1 の第 1 端部 2 8 3 A は、シールハウジングの吸気孔 2 6 5 に係合または称賛するハウジング孔開口を画定することができ、導管フレームの端部 2 8 3 B は、直接的にまたはコネクタを介してのいずれかで気体供給導管の端部に係合または結合する導管孔を表すことが理解されよう。

【手続補正 1 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 2 3 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 2 3 1】

ヨーク 2 0 8 は、ヘッドギア 2 5 0 のストラップに付着するように構成される。実施形態において、図 3 5 および 3 6 に示されるとおり、ヘッドギア 2 5 0 は、患者の頭部の後ろを包むように構成される後部ストラップ 2 5 8、患者の頭部の頂部の上を包むように構成される上ストラップ 2 5 4、および使用中患者の頬に沿って延在するように構成される前部または側部ストラップ 2 5 2 の対を含むストラップの組立体を含む。様々なストラップの各々は、一部が他の部分の延長部分である一体的なコンポーネントとして形成され得、かつ/またはそうでなければ後に永続的に一緒に接続されるか、もしくは互いに対して解放可能な接続のために構成されているかのいずれかである別個に形成されたストラップ部分であり得る。例えば、図示の一形態において、後部ストラップ 2 5 8 は、使用中に患

者の頬に沿って延在するために前部または側部ストラップ 2 5 2 を形成する側部延長部を含み、上ストラップ 2 5 4 は、各端部において、ヘッドギアのそれぞれの各側で後部 2 5 8 または側部 2 5 2 ストラップのいずれかのそれぞれの部分に接続される。別の形態において、各側部ストラップ 2 5 2 は、ヘッドギア組立体の後部ストラップ 2 5 8、例えば後部ストラップ 2 5 8 の自由端部または自由端部に結合されたコネクタに後部コネクタコンポーネントにより取り付けられるかまたは解放可能に接続され、上ストラップ 2 5 4 は、後部ストラップ 2 5 8 に一体的に形成されるかまたは解放可能に接続される。なお別の形態において、上ストラップ 2 5 4 は、使用中に患者の頬に沿って延在するために前部または側部ストラップ 2 5 2 を形成する側部延長部を含み、後部ストラップ 2 5 8 は、ヘッドギアのそれぞれの各側において、上 2 5 4 または側部 2 5 2 ストラップのいずれかのそれぞれの部分に（永続的または解放可能に）各端部で接続される。

【手続補正 1 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 2 3 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 2 3 3】

各側部ストラップ 2 5 2 は、コネクタが取り付けられ得る自由端部を含み得る。各コネクタは、ヨーク 2 0 8 に位置する相補的ストラップコネクタに係合し得る。この実施形態において、ヨーク 2 0 8、は実質的に長尺状であり、かつヨーク 2 0 8 の各端部にまたはヨーク 2 0 2 の各端部の近くに位置するストラップコネクタを含む。

【手続補正 1 6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 2 3 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 2 3 4】

側部ストラップ 2 5 2 とヨーク 2 0 8 との間の接続は、スナップ式の接続、スクリュ式およびねじタイプ接続、またはフック接続などの任意の好適な接続の形態であり得る。一形態において、ヨーク 2 0 8 の各ストラップコネクタは、ヨーク 2 0 8 の各端部に位置する端部キャップ 2 9 1（図 8 3 を参照されたい）を含む。各端部キャップ 2 9 1 は、端部キャップ 2 9 1 をそれぞれの側部ストラップ 2 5 2 の各端部に固定するために、それぞれの側部ストラップ 2 5 2 のコネクタを受けよう構成される孔または凹部など開口を含み得る。端部キャップ 2 9 1 は、次いで、解放可能（例えば、スナップ式の配置構成を介して）または永続的のいずれかでヨーク 2 0 8 のそれぞれの端部に接続され、それによりヨーク 2 0 8 をヘッドギア組立体の側部ストラップ 2 5 2 へ接続する。別の形態において、側部ストラップ 2 5 2 の自由端部は、それぞれの端部キャップ 2 9 1 内に直接結合されるかまたは永続的に固定され、それぞれの端部キャップ 2 9 1 は、次いで、ヨーク 2 0 8 のそれぞれの端部に解放可能または永続的のいずれかで接続され、それによりヨークをヘッドギア組立体の側部ストラップ 2 5 2 に接続する。

【手続補正 1 7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 2 5 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 2 5 4】

本明細書において説明されたとおり、いくつかの実施形態において、ヨーク 2 0 8 は、自動的に調整可能であるか、または自動調整のヘッドギアシステムにおいて使用されるコア要素、例えばフィラメント 3 4 0 のためのコレクタを形成し得る。図 9 1 に示されるとおり、ヨークフロント 2 9 4 A は、上直線トラック 2 9 6 A と下直線トラック 2 9 6 B と

を含む。この実施形態において、直線トラックデバイダがヨークフロント 294A の背面または内面から後方に突出する。いくつかの実施形態において、ヨーク締結具 314 は、ヨークフロント 294A の長さの一部にわたって略斜めに延在する直線トラックデバイダとして形成または機能する。図示の実施形態において、デバイダ壁 344 は、座金ハウジング 295 の各々と対向する直線トラックとの間に延在する。デバイダ壁 344 は、格納中にフィラメント 340 の自由端部が対向する座金ハウジング 295 において捕捉されることを抑止するように、対向する直線トラックを座金ハウジング 295 から分離する。図示の実施形態において、直線トラック 296A、296B は、ヨーク 208 の上および下エッジの非対称を原因として対称的な鏡像ではない。

【手続補正 18】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0270

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0270】

第 2 形態の鼻マスクインターフェイスにおける主な違いは、ヨーク 451 およびヨークチャンネル 452 の構成に関する。この第 2 形態において、ヨークチャンネル 452 は、特定の位置決め特徴を提供しない。むしろ、ヨークチャンネル 452 は、チャンネル 452 の表面とヨーク 451 の当接外面との間の締まり嵌めを介してヨーク 451 を動かないように受け入れかつ保持するように構成される。特に、図 128 を参照すると、453 で示されるヨークの最大高さは、ヨークチャンネル開口の対応する幅より大きい。半永続的な締まり嵌め接続を作り出すために、ヨークを、ヨークチャンネル 452 内に押し込むのに十分に變形させるための力が求められる。

【手続補正 19】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0272

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0272】

第 3 形態の鼻マスクインターフェイスは、第 1 および第 2 形態と同様であり、同様のコンポーネントは、同様の参照符号を使用する。第 3 形態の鼻マスクインターフェイス組立体は、第 2 形態の鼻マスクインターフェイスにおけるのと同様に、シールハウジング 404 のヨークチャンネル 454 内にヨーク 451 を結合するために締まり嵌めを用いる。しかしながら、第 3 形態におけるシールハウジング 404 のヨークチャンネル 454 の形状および構成は、改良されたヘッドギアベクトルを提供することを可能にするために、ヨーク 451 の長手方向軸を上方に角度を変えるために変更される。ヨーク 451 の上方への角度オフセットまたは傾きは、ヨークチャンネル 454 の形状および図 133 に示されるとおりチャンネルの側面に提供された側方切欠き構造 453 により提供される。図 130 を参照すると、ヨーク 451 の長手方向軸の水平な向きが 456 で示され、これは、鼻マスクインターフェイスの第 1 および第 2 形態の向きである。ヨーク角度の傾きは、455 で示された角度の付いた傾きとともに、第 3 形態のヨーク 451 の長手方向軸 457 で示される。この形態において、傾斜角は、およそ 5° であるが、角度は、必要に応じて様々であり得ることが認められる。

【手続補正 20】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0320

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0320】

第 5 形態の導管フレーム 850 は、第 4 形態の導管フレーム 840 と同様である。主な

違いは、把持タブが、導管フレーム 8 5 0の気体供給導管接続端部において、8 5 2で示される把持突出部の連続または列と交換される点である。シールハウジング接続端部での翼付き領域 8 5 3 および導管部分 8 5 5 は、図 2 0 4 で示された軸 8 5 6 を通って延在する水平面に対して対称的である。

【手続補正 2 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 3 2 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 3 2 2】

対称的なシールハウジング配置構成で、導管フレーム 8 5 0 は、互いに対して 1 8 0 ° 回転される 2 つの向きのいずれかにおいてシールハウジング 8 6 2 内へ接続され得る。追加的に、導管接続端部 8 5 9 での角度が付いているオフセットは、導管がユーザの脚に面するかユーザの脚に向かって延在することを可能にするために、導管フレームがシールハウジング 8 6 2 へと、導管接続端部 8 5 9 に下向きに角度が付いている第 1 の向きで組み立てられることを可能にするか、または代替形態は、導管がユーザの前額の方向において上方に延在し得るように、導管接続端部 8 5 9 に上方に角度が付いているように第 2 の向きにおいて設置され得る。

【手続補正 2 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

鼻マスクインターフェイス組立体であって、
シールハウジングと、

マスク空洞を画定するために前記シールハウジングに接続されるかまたは接続可能な可撓性鼻シールであって、顔に接触する側と外側との間に延在し、かつ

前記マスク空洞内への鼻受入開口を画定するエッジを含み、かつユーザの鼻の周りを密封するように構成される接触面と、

鼻下支持体であって、前記鼻シール内へ動かないように接続され、かつ前記マスク空洞内で延在するように構成され、かつ前記ユーザの鼻下表面の少なくとも一部に接触するように方向付けられる接触面を有する鼻下支持体と

を含む可撓性鼻シールと

を含む鼻マスクインターフェイス組立体。

【請求項 2】

前記接触面は、前記ユーザの鼻の先端と前記ユーザの鼻梁の中心との間に延在する領域における前記鼻梁の一部にわたるところを含めて前記ユーザの鼻の周りを密封する、請求項 1 に記載の鼻マスクインターフェイス組立体。

【請求項 3】

前記鼻下支持体は、少なくとも、前記鼻シール内の対向する側または上側方領域の接続位置間で前記マスク空洞内において前記鼻シールにわたって側方に延在する、請求項 1 または 2 に記載の鼻マスクインターフェイス組立体。

【請求項 4】

前記鼻シール内の対向する側または上側方領域の前記接続位置は、前記鼻シールの前記接触面の前記エッジから離されているかまたは変位されている、請求項 3 に記載の鼻マスクインターフェイス組立体。

【請求項 5】

前記鼻シール内の前記対向する側または前記上側方領域の前記接続位置は、前記鼻シール

ルの前記接触面から変位されている、請求項 3 または 4 に記載の鼻マスクインターフェイス組立体。

【請求項 6】

前記鼻下支持体は、前記マスク空洞内から延在し、かつ前記鼻シールの上唇領域において前記鼻シールの前記接触面の前記エッジに接続する 1 つまたは複数の延長または接続部分を含む、請求項 3 ~ 5 のいずれか一項に記載の鼻マスクインターフェイス組立体。

【請求項 7】

前記鼻下支持体は、少なくとも、主側方部分であって、前記鼻シール内の対向する側または上側方領域の接続位置間で前記マスク空洞の少なくとも一部にわたって側方に延在する 2 つの端部を備えた主側方部分を含む、請求項 1 ~ 6 のいずれか一項に記載の鼻マスクインターフェイス組立体。

【請求項 8】

前記鼻下支持体は、前記鼻シールの上唇領域で前記主側方部分から前記鼻シールに向かって延在し、かつ前記鼻シールに接続する 1 つまたは複数の延長または接続部分をさらに含む、請求項 7 に記載の鼻マスクインターフェイス組立体。

【請求項 9】

前記鼻下支持体は、前記主側方部分と、前記鼻シールの上唇領域における前記接触面の前記エッジの一部との間に延在する中央接続部分をさらに含む、請求項 7 に記載の鼻マスクインターフェイス組立体。

【請求項 10】

前記鼻下支持体の前記中央接続部分は、接触面であって、ユーザの鼻の鼻下表面の鼻中隔の柱の少なくとも一部と接触するように主に構成される接触面を有する、請求項 9 に記載の鼻マスクインターフェイス組立体。

【請求項 11】

前記鼻下支持体の前記中央接続部分は、前記主側方部分に接続する端部でのより厚い領域、および前記接触面の前記エッジに接続する端部でのまたは前記接触面の前記エッジに接続する端部に向かうより薄い領域からその長さによって厚さが変化する、請求項 9 または 10 に記載の鼻マスクインターフェイス組立体。

【請求項 12】

前記鼻下支持体の前記中央接続部分は、その端部での幅に比べて幅が減少した中央領域を含む、請求項 9 ~ 11 のいずれか一項に記載の鼻マスクインターフェイス組立体。

【請求項 13】

前記鼻下支持体の前記主側方部分は、各端部において、前記鼻シールの内面から延在するそれぞれのリブを介して間接的に前記鼻シールの前記内面に一体的にまたは動かないように接続される、請求項 7 ~ 12 のいずれか一項に記載の鼻マスクインターフェイス組立体。

【請求項 14】

各リブは、前記鼻シールの前記内面の一部に接続される第 1 接続エッジ部分と、第 2 接続エッジ部分であって、前記鼻下支持体の前記主側方部分のそれぞれの端部にその周辺エッジの別の部分において接続される第 2 接続エッジ部分とを有する可撓性材料のパネルを含む、請求項 13 に記載の鼻マスクインターフェイス組立体。

【請求項 15】

一緒に組み立てられたときの前記シールハウジングおよび鼻シールの全高対全奥行の比は、およそ 1 : 0.8 ~ およそ 1 : 1.2 の範囲である、請求項 1 ~ 14 のいずれか一項に記載の鼻マスクインターフェイス組立体。